

二次イオン質量分析装置*1

鈴木 敏子*2 藤村 亨*3 長沼 敬一*4 清水 真人*5

Secondary Ion Mass Spectrometer

Toshiko Suzuki, Tōru Fujimura, Keiichi Naganuma, Masato Shimizu

1 はじめに

二次イオン質量分析法は、多くの表面分析手法のなかでも最も高感度であること、全元素の分析が可能であること、精度の高い測定

Table 1 Specifications of IX 70 S

Ion sources	O ₂ ⁺	C _s ⁺	G _e ⁺
Source voltage	1-20 kV	1-10 kV	30 kV
Min. spot size	2 μm	2 μm	0.1 μm

置では、さらに別のポートに細いビームが容易に得られる Ga の液体金属イオン源を取り付け、Ga のイオン源として用いる。

また、イオン源のチップを交換することにより、他の液体金属

能を落とすことなく同一の試料室に取り付けることを可能にした。

これによって高質量分解能が求められる場合には、この方法

(5)

1